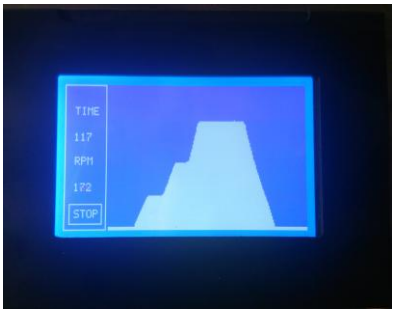
یکسال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش

آزمایشگاه کوچک MEMS

Mini MEMS Lab

آزمایشگاه MEMS از جمله دستگاه های جدید است که به صورت همزمان و در محیطی کاملا ایمن امکان پوشش دهی ویفر یا زیرلایه و همچنین شستشو، اچینگ و لیتوگرافی را در داخل یک مجموعه به صورت منسجم جهت ساخت سیستم های بر پایه چند مرحله لیتوگرافی فراهم می سازد. این مجموعه با نصب اسپین کوتر در داخل یک مجموعه ضد اسید امکان پوشش دهی دورانی امکان استریپ کردن فوتورزیست و یا اچ کردن کنترل شده را فراهم می سازد. همچنین به کمک سیستم لیتوگرافی با همتراز کننده ماسک در داخل مجموعه ای با میز تمیز، چندین مرحله لیتوگرافی بر روی یک زیرلایه نیز امکان پذیر می باشد.

قابلیت ها:



- ✓ اسپین کوتر با قابلیت شستشو به صورت ادغام شده در مجموعه
- ✓ ذخیره و اعمال پروفیل سرعتی متشکل از ۱۲ بخش
- ✓ امکان پوشش دهی به دو صورت دستی و خودکار
- ✓ قابلیت نمایش آنلاین پروفیل سرعت بر روی صفحه
- ✓ امکان ایجاد سرعت دورانی تا ۵۰۰۰rpm
- ✓ ورود اطلاعات و نمایش بر روی صفحه LCD لمسی
- ✓ تزریق گاز خنثی به داخل محفظه
- ✓ قابلیت کار با ویفر تا ۶ اینچ
- ✓ سینک ضد اسید برای شستشو
- ✓ مکش از پشت و بالای سلول ها
- ✓ سیستم گرمایش و کنترل دمای محلول
- ✓ تایمر کنترل زمان گرمادهی به محلول
- ✓ تامین نور ۳۷۵nm یا ۴۲۰nm
- ✓ همتراز کردن زیرلایه نسبت به ماسک جدید
- ✓ قابلیت تنظیم مدت زمان نوردهی
- ✓ نمایش ماسک و زیرلایه توسط میکروسکوپ دیجیتال